

NUBIC知的財産情報開示

開示日： 2008年11月21日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

	NUBIC管理番号: <input type="text" value="2007000114"/> 整理番号 <input type="text" value="11238"/> 担当者 <input type="text" value="加根魯 和宏"/>			
表 題	<input type="text" value="微細放電加工とエッチングとを組み合わせた微細形状加工法"/>			
技術分野	<input type="text" value="機械・加工"/>	<input type="text" value="化学・薬品"/>	<input type="text" value="医療"/>	<input type="text"/>
適用製品	<input type="text" value="医療関係で注目されているマイクロTAS用"/>			
目 的	<input type="text" value="工具を用いた機械加工やリソグラフィ技術を用いることなく、マイクロTAS (Total Analysis Systems) に用いられている微細な流路を容易に創成できる方法を提案する。"/>			
技術概要	<input type="text" value="加工対象となる材料(例:ガラスやシリコン等)の表面にマイクロメートル程度以下の金属薄膜を蒸着する。これをXYテーブルに載せて、材料の表面とこれに近接した電極との間で微細放電を起こし、表面上に2次元の微細なパターンを描く。これに引き続きエッチングを行うことによって、薄膜が除去されたパターンに従って加工対象が除去される。この後に蒸着した薄膜を除去すると、加工対象の表面に微細放電によって描かれたマイクロメートルあるいはそれ以下の微細な溝を容易に加工することができる。"/> <input type="text" value="本方法は最近注目されているマイクロTASに用いられる流路のパターンを創生するのに応用でき、その他にも本加工方法が広く応用できるものと考えられる。"/>			

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。

(FAX, e-mail, 郵送いずれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。

面談希望日時	<input type="text"/>		
(ふりがな) 氏 名	<input type="text"/>		
会社名	<input type="text"/>		
所 属	<input type="text"/>	役職	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		
連絡事項	<input type="text"/>		



【申込み・問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL:03-5275-8139 FAX:03-5275-8328 E-mail:nubic@nihon-u.ac.jp